

利用登録状況 (入退室システム登録者数 令和2年3月末時点)

教員(研究員を含む) と学生のみを抽出

学系	研究室名	教員	学生	総計	
電子システム	半導体工学	3	13	16	66
	電子デバイス工学	2	4	6	
	電子物性工学	1	15	16	
	光エレクトロニクス	2	18	20	
	光エンジニアリング	1	1	2	
	応用物質科学	3	3	6	
材料化学	高分子物理学	3	12	15	24
	高分子物性工学	1	3	4	
	高分子フォトンクス	1		1	
	応用高分子化学	1		1	
	アモルファス工学	1	1	2	
	機能高分子設計		1	1	
機械	輸送現象制御学	1	10	11	21
	特殊加工学	1		1	
	先端材料学	1	1	2	
	表面機能創成学	1	6	7	
繊維	先端ファイブロ科学		1	1	1
合計		23	89	112	

112名中、
29名は
機器利用登録無し

利用登録状況（機器利用登録者数 令和2年3月末時点）

		電子システム					材料化学				機械		合計
		半導体工学	電子デバイス工学	電子物性工学	光エレクトロニクス	光エンジニアリング	応用物質科学	高分子物理学	高分子物性工学	高分子フォトニクス	機能高分子工学	輸送現象制御学	
フォトリソグラフィ装置	MIKASA アライナ	4	1										5
	両面マスクアライナ	1	5								11		17
	キャノン アライナ												0
	スプレーコーター												0
	有機ドラフト	5			1						11		17
成膜装置	RFスパッタ装置	1	1										2
	電子ビーム蒸着装置	2											2
	LL式電子ビーム蒸着装置	2											2
	実験用熱蒸着装置	2									1		3
	TEOS-CVD装置	3			1								4
ドライエッチング装置	Siディープエッチング装置		4			2	1						7
	化合物半導体エッチング装置	2	1		1								4
	簡易プラズマ処理装置	4						5			1	11	21
洗浄・ウエットエッチング装置	酸ドラフト	6	1		1						11		19
熱処理装置	熱処理炉	2											2
	急速アニール炉	5											5
	小型拡散炉	1											1
評価装置	電界放出型高分解能走査電子顕微鏡	11			9		1		3				24
	段差膜厚計	10	5		13		2	13		1		11	55
	レーザー顕微鏡	1			2							11	14
	卓上SEM (EDX)	7			5								12
分析装置	X線光電子分光装置	3	1				2					1	7
	高精度X線回析装置	14	3		5		1						23

研究室別利用時間と共用率(平成31年4月~令和2年3月)

	装置名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合計	管理 使用 時間 研究室	共有 率
		光 エ ン ジ ニ ア リ ン グ	光 エ レ ク ト ロ ニ ク ス	電 子 デ バ イ ス 工 学	半 導 体 工 学	応 用 物 質 科 学	電 子 物 性 工 学	高 分 子 物 理 学	高 分 子 物 性 工 学	高 分 子 フ ォ ト ニ ク ス	輸 送 現 象 制 御 学	機 能 高 分 子 設 計	先 端 材 料 学			
1	MIKASA アライナ	0.0	0.0	0.0	54.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.5	0.0	100.0%
2	両面マスクアライナ	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.3	0.0	0.0	35.9	1.7	95.4%
3	キャノン アライナ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
4	スプレーコーター	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
5	有機ドラフト	0.0	2.0	0.0	98.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	199.8	0.0	0.0	300.3	0.0	100.0%
6	RFスパッタ装置	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
7	電子ビーム蒸着装置	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
8	LL式電子ビーム蒸着装置	0.0	0.0	0.0	24.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.8	24.8	0.0%
9	実験用熱蒸着装置	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
10	TEOS-CVD装置	0.0	0.0	0.0	61.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.0	0.0	100.0%
11	Siディープエッチング装置	0.0	0.0	26.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.8	26.8	0.0%
12	化合物半導体エッチング装置	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	100.0%
13	簡易プラズマ処理装置	0.0	0.0	0.0	14.8	0.0	0.0	102.4	0.0	0.0	67.6	0.0	0.0	184.8	14.8	92.0%
14	酸ドラフト	0.0	3.0	1.0	99.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	104.3	0.0	100.0%
15	熱処理炉	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0%
16	急速アニール炉	0.0	0.0	0.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	23.0	0.0%
17	小型拡散炉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
18	電界放出型高分解能走査電子顕微鏡	0.0	112.5	0.0	161.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	274.3	0.0	100.0%
19	段差膜厚計	0.0	31.0	75.3	62.8	6.5	13.0	213.4	0.0	0.0	33.0	0.0	0.0	435.1	0.0	100.0%
20	レーザー顕微鏡	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	6.5	0.0	100.0%
21	卓上SEM(EDX)	0.0	15.5	0.0	90.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	107.0	0.0	100.0%
22	X線光電子分光装置	0.0	0.0	0.0	204.3	0.0	97.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.5	301.3	97.0	67.8%
23	高精度X線回析装置	0.0	8.0	21.4	2377.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2406.9	21.4	99.1%
														189.5	9.3	95.1%

共有率 95.1%

月別装置稼働時間 (令和元年度)

装置名	稼働時間実績												年間合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
MIKASA アライナ			1.5	4.5	3.5	10	1		1.5	16.5	15	1	54.5
両面マスクアライナ	5	6.25	2.5	1	4	2	1.667		3	2.5	0.5	7.5	35.9
キャノン アライナ													0.0
スプレーコーター													0.0
有機ドラフト	21.5	30.75	23.25	15	35	32.75	8		35.75	32.75	23	42.5	300.3
RFスパッタ装置													0.0
電子ビーム蒸着装置													0.0
LL式電子ビーム蒸着装置			1	2	1.5	5	7.5	2.5	4.25	1			24.8
実験用熱蒸着装置													0.0
TEOS-CVD装置		3	4	9			5	2	6	12.5	14.5	5	61.0
Siディープエッチング装置							16.5	3.25	7				26.8
化合物半導体エッチング装置			4.5	2									6.5
簡易プラズマ処理装置	15	18.25	11.25	6.75	16.5	27.25	14.67	4.167	9.333	28.75	20.08	12.75	184.8
酸ドラフト	4	4.5	15.25	10.5	13.5	8.5	6.5	2.5	5.5	14	12	7.5	104.3
熱処理炉		4				1							5.0
急速アニール炉		0.5	1					3.5	5	7.5	4	1.5	23.0
小型拡散炉													0.0
電界放出型高分解能走査電子顕微鏡	6	25.5	30.5	48	30.58	22.5	29	17.58	24.5	32.67	6.5	1	274.3
段差膜厚計	17.25	21.83	27.83	25	38.67	43.08	38	43	74	60.25	21	25.17	435.1
レーザー顕微鏡	0.75			5									5.7
卓上SEM (EDX)	3.25	5.75		5	11.75	7	13	1.5	7.5	4.25		48	107.0
X線光電子分光装置	73.25	61		45.25	22	4.5	35	7.75	29	51			328.8
高精度X線回析装置	134	243.3	217.2	143.3	187.5	188.7	249.5	304	287.5	239	126	87	2406.9